

マスク・ウェハ検査用対物レンズ

特長

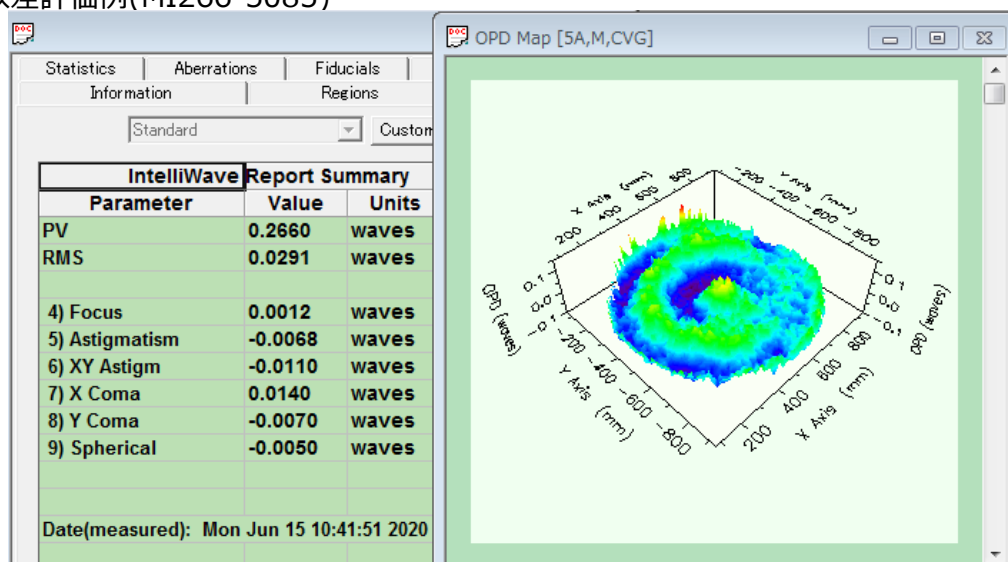
- ◎屈折光学系なので無遮蔽・長作動距離です。
- ◎レーザーのスペクトル内で色消ししているので、良好な結像特性が得られます。
- ◎干渉計により波面収差を測定して設計性能を数値保証します。
- ◎半導体マスク・ウェハ観察用途に適しています。



マスク・ウェハ検査用対物レンズMIシリーズは広視野・長作動距離と無収差を両立し、半導体フォトマスク・ウェハ検査に適しています。

インターフェース部・各種リレーレンズのカスタム対応可能です。

●透過波面収差評価例(MI266-5085)



オプティクス、レーザ、精密光学機器のリーディングカンパニー

KYOCERA 京セラSOC株式会社

お問い合わせ

TEL : 045-931-6592

<https://www.ksoc.co.jp/shiryo/>

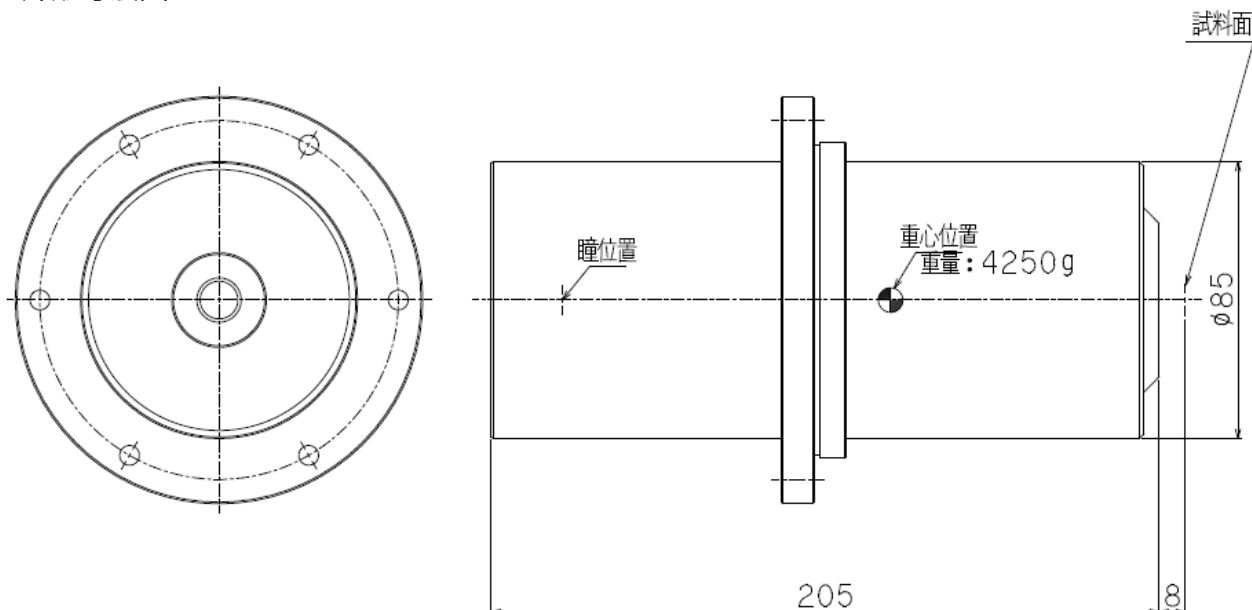
担当：営業部 小林・木村 宛



●ラインナップ

モデル名	MI193-5085	MI213-5085	MI248-5085	MI266-5085	MI355-5085
波長	193nm	213nm	248nm	266nm	355nm
バンド幅 (半値全幅)	10pm	15pm	20pm	30pm	100pm
タイプ	屈折型				
開口数 (NA)	0.85				
焦点距離	5mm				
透過率	80%以上				
視野	φ0.45mm				
波面収差	≦ 0.03 waves rms				
作動距離	≧ 8mm				
寸法	φ85mm×L205mm (フランジ部除く)				
重量	約4250g				

●外形寸法図



本資料の内容は予告なく変更する場合があります。詳細についてはお問合せください。

オプティクス、レーザ、精密光学機器のリーディングカンパニー

KYOCERA 京セラSOC株式会社

お問い合わせ

TEL : 045-931-6592

<https://www.ksoc.co.jp/shiryo/>

担当：営業部 小林・木村 宛

